

最先端の表面分析装置ラインアップ

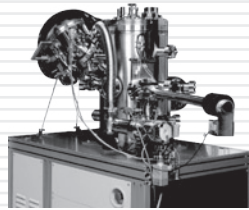
X線光電子分光分析装置

ESCA

走査型X線による自動中和・モノクロXPS測定



IPHI Quantera II
Scanning XPS Microprobe



IPHI 5000 VersaProbe II
Multi-Technique XPS



IPHI X-tool
Automated XPS

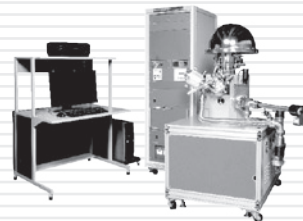
オージェ電子分光分析装置

AES

究極の表面微小部分分析



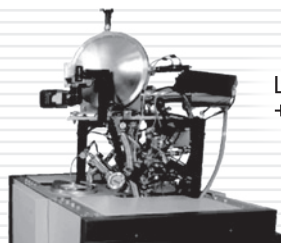
IPHI 700 Xi
Scanning AES Nanoprobe



IPHI 4700 Thin Film Analyzer
Scanning AES Depth Profiler

二次イオン質量分析装置

SIMS



IPHI TRIFT V nanoTOF
Time-of-Flight SIMS

LMIGクラスターイオン銃による
サブミクロンの有機物分析を実現



IPHI ADEPT-1010
Automated Depth Profiling Tool

アルバック・ファイ株式会社

本社・工場 〒253-8522 茅ヶ崎市円蔵370番地 TEL: 0467-85-4220 (国内営業部) FAX: 0467-85-4411
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル5階 TEL: 06-6350-2670 FAX: 06-6350-2980

www.ulvac-phi.com